直線集東ビーム超音波材料解析システムによる

SiO₂薄膜装荷 36° YカットLiTaO₃の評価

Evaluation of 36°Y-cut LiTaO₃ with SiO₂ thin film by the line-focus-beam ultrasonic material characterization system

 $^{\circ}$ 末永 凌大¹, 鈴木 雅視¹, 垣尾 省司¹, 大橋 雄二², 荒川 元孝², 櫛引 淳一²

(1. 山梨大学, 2. 東北大学)

[°]Ryota Suenaga¹, Masashi Suzuki¹, Shoji Kakio¹, Yuji Ohashi², Mototaka Arakawa², Jun-ichi Kushibiki²

(1. Univ. of Yamanashi, 2. Tohoku Univ.)

E-mail: g17te014@yamanashi.ac.jp

1.はじめに

直線集東ビーム超音波材料解析(LFB-UMC) システムは、弾性波デバイスに用いられる基板 や薄膜材料の弾性的性質を非破壊・非接触で高 精度に定量計測可能である^[1]. この手法は、水 を負荷した試料表面を伝搬する漏洩弾性表面 波(Leaky SAW: LSAW)の位相速度と規格化伝 搬減衰を測定する.著者らは、合成石英基板上 に Ta₂O₅ 薄膜を装荷した試料を用いて、 LFB-UMC システムによる減衰の測定値から LSAW の水への漏洩損失の理論値を差し引く ことによる音響損失評価の可能性を示した^[2]. 本報告では、漏洩損失の大きさが音響損失と

近い値を有する LSAW が励振される構造であ る, SiO₂ 薄膜装荷 36°Y カット X 軸伝搬 LiTaO₃(36°YX-LT)を取り上げ, LFB-UMC シス テムを用いて LSAW の位相速度と伝搬減衰を 測定し, 理論値と比較した結果について述べる.

2. 理論解析

SiO₂薄膜を装荷した 36°YX-LT 上に,水を負荷した構造について,LSAWs の位相速度と規格化減衰を計算した.薄膜の膜厚 H と周波数 f の積 fH に対する位相速度を Fig. 1 に,規格化減衰を Fig. 2 に示す.理論計算に用いた SiO₂ と LiTaO₃の材料定数は Kushibiki らの報告値である^{[3][4]}.LSAW の位相速度は, fH の増加に従って,単体 SiO₂基板上の LSAW 速度に収束せず,その速度よりも遅い速度に収束する.また,規格化減衰は, fH が増加すると単調に減少していく傾向がある.一方で,Oth LPSAW の速度と減衰は SiO₂単体の値へと収束する.

3. 実験

36°Y カット基板上に, RF スパッタリング装置を用いて SiO₂ 薄膜を成膜し, 膜厚 *H*=9.8 μm を有する試料を作製した. 成膜条件は, Ar:O₂ ガス流量比, 成膜中の雰囲気ガス圧, RF 電力 を, それぞれ 5:1 sccm, 2.0 Pa, 200 W とした.

LFB-UMC システムを用いて, LSAWs の位 相速度と規格化減衰を周波数 *f*=100-275 MHz の範囲で測定した.その結果を Figs. 1, 2 に 示す.LSAW 速度と減衰測定値の*fH*に対する分散 の様相は理論値と概ね一致している.また,0th



Fig. 2 Normalized attenuation vs fH for LSAWs.

LPSAW 速度測定値と理論値も概ね一致しているが, その減衰測定値は理論値と様相が異なった.測定値 と理論値の相違は,作製した薄膜の弾性特性の相違 を含んでいると考えられる.なお,1stLPSAWの応 答は観測されなかった.

今後, SiO₂薄膜の材料定数を算定し,音響損 失を評価する.

参考文献

- J. Kushibiki and N. Chubachi: IEEE Trans. Sonics Ultrason. SU-32 (1985) 189.
- [2] 末永, 他, 第 65 回応用物理学会春季学術講演予 稿集, 19p-P2-7 (2018).
- [3] J. Kushibiki, et al.: IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 49 (2002) 827.
- [4] J. Kushibiki, et al.: IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 53 (2006) 385.